

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年6月9日 (09.06.2005)

PCT

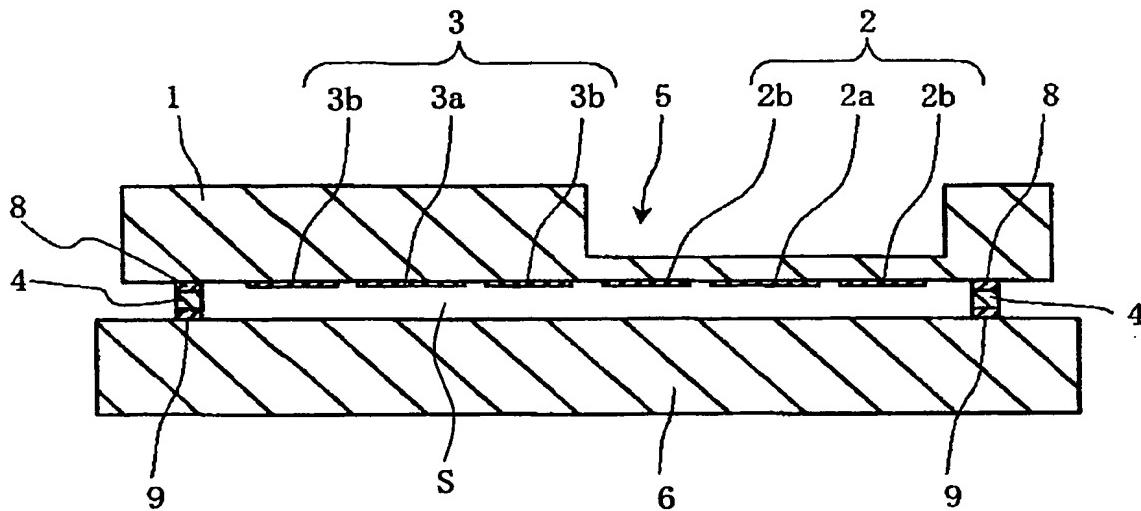
(10)国際公開番号
WO 2005/052533 A1

(51)国際特許分類 ⁷ :	G01L 9/00		6128501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 Kyoto (JP).
(21)国際出願番号:	PCT/JP2004/017978		(72)発明者; および
(22)国際出願日:	2004年11月26日 (26.11.2004)		(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 百瀬一久 (MO-MOSE, Kazuhisa) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社 鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 松尾香 (MATSUO, Kaoru) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社 鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 下木原伸一 (SHIMOKIHARA, Shinichi) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社 鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 井之上久幸 (INOUE, Hisayuki) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社 鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 鎌田将史 (KAMADA, Masashi) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社 鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 立岡博志 (TACHIOKA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社 鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP).
(25)国際出願の言語:	日本語		
(26)国際公開の言語:	日本語		
(30)優先権データ: 特願2003-397226	2003年11月27日 (27.11.2003)	JP	
特願2003-398797	2003年11月28日 (28.11.2003)	JP	
特願2003-431559	2003年12月25日 (25.12.2003)	JP	
(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 京セラ株式会社 (KYOCERA CORPORATION) [JP/JP]; 〒			

(統葉有)

(54) Title: PRESSURE SENSOR DEVICE

(54)発明の名称: 圧力センサ装置



(57) Abstract: A sensor substrate (1) having on its lower surface a surface acoustic wave element (2) for detecting pressure is mounted on a supporting substrate (6) through a sealing member (4) surrounding a sensor section (2). A sealing space S is formed by the sensor substrate (1), the supporting substrate (6), and the sealing member (4), and the surface acoustic wave element (2) for detecting pressure is sealed hermetically in the sealing space S. Reliability can be enhanced by protecting the surface acoustic wave element (2) from the external environment.

(57)要約: 下面に圧力検出用弹性表面波素子2を有するセンサ基板1を、センサ部2の周囲を取り囲む封止材4を介して支持基板6上に載置する。前記センサ基板1、前記支持基板6及び前記封止材4で囲まれる封止空間Sを形成し、この封止空間S内に前記圧力検出用弹性表面波素子2を気密封止する。圧力検出用弹性表面波素子2を外部環境から保護することにより、信頼性を向上させることができる。

WO 2005/052533 A1



1号 京セラ株式会社 鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 丸田 幸一 (MARUTA, Kouichi) [JP/JP]; 〒8994396 鹿児島県国分市山下町 1番1号 京セラ株式会社 鹿児島国分工場内 Kagoshima (JP). 岡 浩史 (OKA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒6128501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6番地 京セラ株式会社内 Kyoto (JP).

(74) 代理人: 稲岡 耕作, 外 (INAOKA, Kosaku et al.); 〒5410054 大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号 サンマリオンNBタワー21階 あい特許事務所内 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。